

解決方案
展覽

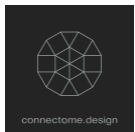
EXPO合作
企業展覽

圖像處理關聯
研討會

EXPO合作企業展覽區域

CCS 合作公司的視覺檢測解決方案

OKI



JE International corporation

computar

TPC
MACHINE VISION LENS

Next Technology

BASLER

FANATIC

Hutzper

MITSU
ミツテック株式会社

MICRO-TECHNICA

icore
innovation to the Core

VICO imaging.com

VOMMA

WHEC

解決方案
展覽

EXPO合作
企業展覽

圖像處理關聯
研討會

EXPO合作企業展覽區域

有益於圖像處理檢測難題解決的技術應用研討會

12月4日 (三) 10:30~11:30 “光源管理最新技術和新型電控OPPX的介紹”

13:30~15:00 “圖像處理檢測中光源的作用 基礎編”

12月5日 (四) 10:30~11:30 “針對有圖像導入想法的客戶介紹Solution愛 (AI)”

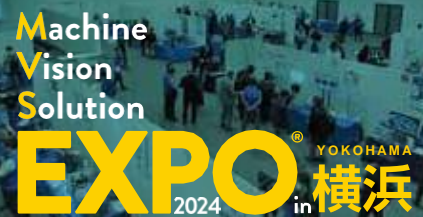
13:30~14:30 “光源 + α問題解決！ 方案實例介紹 Part2”

12月6日 (五) 10:30~11:30 “SWIR & 深紫外研討會暫定”

13:30~15:00 “圖像處理檢測中光源的作用 基礎編”

注意事項

- 所有研討會均以日語進行。研討會需提前預約。想參加的請跟銷售代表洽詢或發郵箱至marcom@ccs-inc.co.jp。
- 內容詳情，請跟銷售代表洽詢。
- 根據實際情況，研討會的內容可能會有所變動。



在網上完成參加申請！

申請錶：https://e-ve.event-form.jp/event/87865/expo2024yokohama_global
為避免會場過度擁擠，我們限制入場人數，來訪前請提前申請。名額有限，請儘快申請。



CCS CCS Inc.

CCS Inc. 臺灣代表處

臺灣臺北市中山區南京東路二段76號4樓
恆豐商務中心一館 郵編：10457
TEL. +886-2-2581-7676
Email: taiwan-tr@ccs-inc.co.jp

京都總部 (京都, 日本)

TEL: +81-75-415-8284
E-mail: sales@ccs-inc.co.jp
<https://www.ccs-grp.com/>

Copyright © 2024 CCS Inc. All Rights Reserved.
Content current as of Sep 2024. CHA-0037-2409



在展會3天,發現“可見”

2024

12/4 ~ 6

(三)

(五)

10:00 ~ 17:00 ※最後入場時間 16:00

日程

場地

橫濱新都市大廈9樓新都市大廳

神奈川縣橫濱市西區高島2-18-1橫濱新市大廈9樓 (SOGO橫濱店)
· 從橫濱站步行5分鐘
· JR線、京急線、東急東橫線、相模鐵道線、橫濱市營地下鐵線、港未來線
· 從Pacifico Yokohama步行20分鐘

從橫濱站東口步行一小段距離



解決方案展覽

我們將展出40多種與檢測測量相關的解決方案！

LIGHTING SOLUTION
CCS Inc.

EXPO合作企業展覽

我們的合作公司將展出他們的機器視覺解決方案。

圖像處理關聯研討會

我們將舉辦影像處理技術研討會。
* 研討會將以日語進行。

展覽內容詳情請參閱內頁。

展品40種以上！CCS “最新” 解決方案展示！

將展出許多新產品和解決方案！

“可見” “可解決” 我們準備了各種各樣的解決方案。

3D&感測器區域

▶3D測量解決方案 **NEW**

展示使用GigE相機的光學切割法進行3D測量。根據要檢測的對象物進行合適的光學設置，可獲得最佳的3D數據。

波長解決方案區域

▶最新SWIR *1 深紫外應用檢測案例 **NEW**

- 超高功率紅外光源 (1120nm)
比傳統1000nm以上紅外光源HLV-IR120亮100倍以上。
*2 亮度高，可用於解決目前檢測困難的案子，可提高檢測速度。
- 深紫外~近紫外應用檢測案例

可見光範圍有望用於目前難以實現的透明物體的可視化，表面傷痕、髒污、斑點等的檢測。有關深紫外區域的應用實例，將使用相機、鏡頭等光學成像器件進行展示。



*1 Short Wavelength InfraRed (短波紅外) *2 同敵司測量所得輻射強度對比

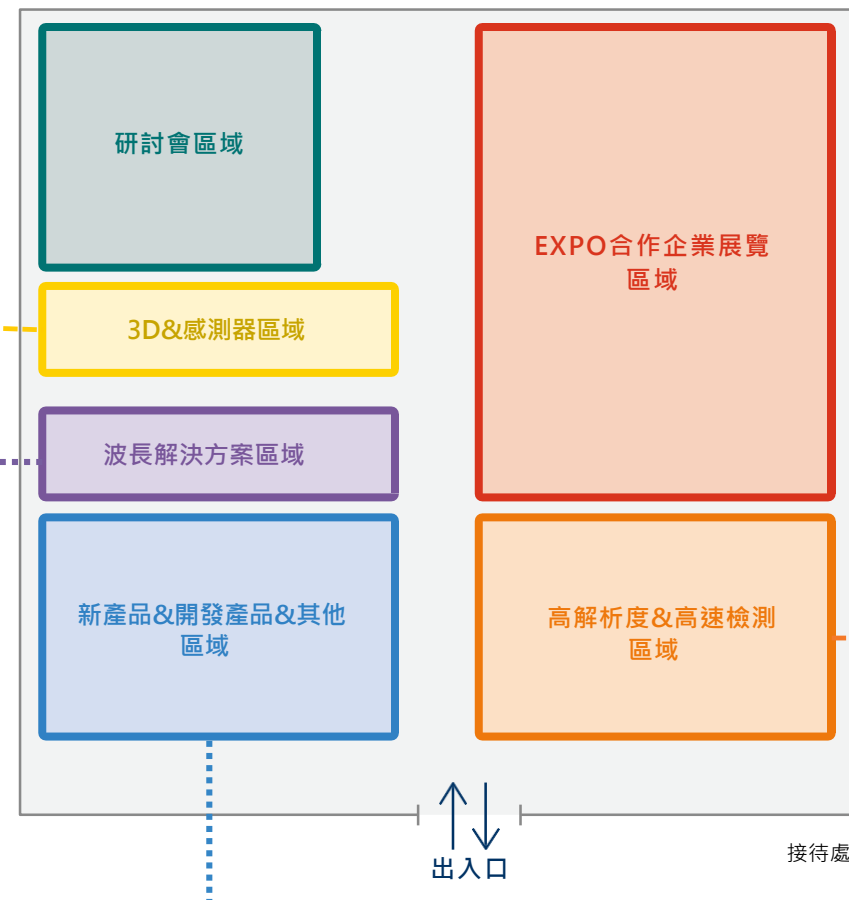
▶高光譜成像檢測

通過分析高光譜相機專用的寬頻紅外LED光源照射所獲得的波長數據，我們可以對不同材質的檢測對象物進行分類檢出。同過去廣泛使用的鹵素光源相比，此光源可對不同材質的檢測對象物進行分類檢出。大幅度降低了對檢測對象物的熱影響以及波長隨時間所產生的變化，從而提供穩定的檢測環境。

▶使用多波段光源的圖像評估系統 **NEW**

基於多個波長拍攝所得圖片，可對檢測對象物可否色差判別進行模擬的評估系統。從而推導出適用於顏色和材質識別的光學設置。

Machine Vision Solution **EXPO** 2024 in 橫濱 YOKOHAMA — 展覽區域分布圖 —



高解析度&高速檢測區域

▶線掃相機 + 光度立體FPGA高速圖像處理 **NEW**

針對去除工件表面的圖案和光量，捕捉褶皺和傷痕等的外觀檢測，通過結合使用Visual Applets的FPGA處理，可提高檢測速度。像素數是傳統的2倍，掃描速度是傳統的10倍，進行實時的圖片處理。

▶超高速面陣相機成像 **NEW**

將展示使用大功率頻閃LED光源和高幀率相機的高速成像解決方案。我們可根據您的要求，為高速生產線提供不易受上下移動和振動影響的全套檢測環境。

▶可捕捉細微劃痕、傾斜和凹痕的成像解決方案

將展示將細微的特徵可視化的案例，CCS提供光源並利用其在光學方面的豐富專業知識將細微特徵可視化。

■ 瞳孔分離偏光裝置&雙折射瞳孔緩衝裝置

採用適用於機器視覺的獨特光學技術，將納米級的細微傷痕、傾斜等可視化。

■ 集成大型鏡頭平行度可變一體化同軸光源

照射光可變的光源和遠心鏡頭一體化，無需與相機進行光軸對準，可進行調整以便檢測出不同程度的缺陷。

■ 通過螢幕投影對透明物體進行成像的技術

搭載大功率LED光源和低倍率鏡頭，通過照射出極高指向性的光線，可對透明物體中難以觀察到的凹凸和紋理進行取像。



新產品&開發產品&其他區域

▶光澤 & 立方體形狀工件外觀檢測解決方案 **NEW**

■ 成像實例：弧形電鍍件



減弱光源的倒影，凸顯凹凸不平區域

■ 成像實例：手柄



凸顯形狀複雜工件表面凹凸不平區域並取像

▶電控PD4系列 擴充產品陣容 **NEW**

新增小型30W及120W 8通道類型，新增輸入觸發信號進行順序切換，可選擇點燈控制設置執行順序的功能，使用變得更方便。

▶支持大容量&快速點燈切換 光源電控CCS-CB-MT系列 **NEW**

可搭載多台大功率線光源，可對應快速點燈切換的圖像檢測案例。將展示4通道合計1,200W電控的使用實例。可同時獲取用多個光源進行取像的圖像，可集成到多掃描系統中。

▶超亮大功率燈箱 PFBR-2400SW

超大輸出功率，亮度約是PFBR-600SW的4倍，不會有氬氣燈因脈衝所產生亮度波動的問題，從而可提供穩定的檢測環境。無需更換燈泡，大大降低了維護成本。



▶使用客製光源解決難題的實例 **NEW**

根據檢測環境和案件的實際情況，將從豐富的客製光源案例中挑選出一些有特點的進行展示，如適合管狀工件內表面檢測的環形光源，可以根據工件的尺寸使照射光成為最適合狀態的鐮刀形圓頂光源。

▶高照度線光源 **NEW**

可適用於對亮度和均勻性均有要求的檢測案例，將展示適用於梨形金屬等表面檢測的線光源。獨特的光學技術，在照射距離為50~100mm的條件下，可實現高照度高均勻照射。

▶貼片LED光源 **NEW**

亮度約是傳統炮彈型LED光源的2~3倍，將展示超薄貼片LED環形光源及專為小型工件檢測而設計的多段式環形光源。

▶大功率&靈活配光的LED光源 EffiLux **NEW**

將展示通過改變透鏡位置和漫射板，來設定各種條件下的最佳照射光線的EFFI-FLEX2系列光源。多功能條形光源，最長可做到2900mm，可見光光源、紫外光源、紅外光源可選。內置驅動，無需使用電控，節約了成本和空間。



※根據實際情況，展示內容可能有變化。請聯繫銷售代表瞭解展示相關產品在各地區是否可以售賣。